



X線イメージング研修会 参加者募集 ～入門コース～

Nanotech CUPAL 第7回放射光利用技術入門コース

放射光を用いたX線イメージングは位相を上手く活用することでラボ装置よりもはるかに高い感度とコントラストを得ることができ、物質内部の3次元構造の可視化や結晶表面の欠陥分析などに威力を発揮することから、バイオ・医療分野、材料構造解析、故障解析などの幅広い分野でその活用に期待が寄せられています。この研修会では放射光利用技術の全般的な概論とX線イメージングの手法の詳細についての講習（1日の座学）、及びPFを用いて2日間の実技実習により、CTとトポグラフィの基礎と実験手法を学びます。

**平成30年
6月12日～14日
開催**



吸収像 屈折角像 超小角散乱像

プログラム

【1日目】 6月12日(火)

- ①放射光の特長、基礎
- ②代表的な分析手法
- ③X線イメージングの手法、事例紹介、詳細
- ④X線トポグラフィの手法、事例紹介、詳細

【2日目、3日目】 6月13日(水)-14日(木)

- ①ビームライン実習1
単色X線CT、単色X線イメージング
- ②ビームライン実習2
X線トポグラフィ、基本は反射型
(場合によっては透過型を含む)

定員 10名程度（未経験者を歓迎します）

日時 平成30年6月12日～14日

会場 KEKフotonファクトリー

受講料 大学・公的研究機関の方は受講費用は無料です。
(企業の方とはご相談下さい。)

CUPALアライアンス機関の若手研究者、博士課程後期の方に対しては旅費の補助が可能です。
詳細はWebサイトでご確認ください。



お問合せ

〒305-0801 茨城県つくば市大穂1-1
高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所

KEK事務局

E-mail kek-cupal@pfqst.kek.jp

TEL 029-864-5200 (内線2522)

URL <http://cupal.kek.jp>